

TEM 観察用薄膜試料加工講習会

参加者：津志田雅之^{A)}、山室賢輝^{A)}

所 属：^{A)} 生産構造技術系

期 間：2012年12月13、14日（木、金）

主 催：宮崎大学 産学・地域連携センター

共 催：大学連携研究設備ネットワーク

場 所：宮崎大学 産学・地域連携センター

機器分析支援部門 共同利用者控室・試料作成室

研修内容

2012年12月13日（木）

13:30～13:40	開会の挨拶	宮崎大学 産学・地域連携センター 機器分析支援部門 境健太郎 准教授
13:40～15:00	講演 「イオンスライサーの概要と試料作製法の紹介」	日本電子株式会社 河原尚 氏
15:20～18:00	イオンスライサー講習会 (試料切り出しと装置への試料セット)	宮崎大学 工学部 教育研究支援技術センター 原口智宏 技術職員

2012年12月14日（金）

9:00～12:00	イオンスライサー講習会（1次ミリング）	宮崎大学 工学部 教育研究支援技術センター 原口智宏 技術職員
13:00～15:00	イオンスライサー講習会（2次ミリング）	

半導体、セラミックス、金属のような硬質な試料の TEM 観察には、イオンミリングによる試料の薄膜化を行う必要がある。イオンスライサーは熟練した技術を必要とする従来法に比べて試料加工工程が簡略化されており、より気軽に試料加工が行えるようになった装置である。宮崎大学では日本電子（株）のイオンスライサーを所有しており、学内外から試料加工の要望に応じている。本講習会ではイオンスライサーについての講演と、半導体材料の断面 TEM 観察用の試料加工の実演講習が行われ、イオンスライサーにおける一連の TEM 試料加工工程を体験することが出来た。また本講習会を通して、参加した九州地区の TEM 関連の研究に従事する職員との有意義な技術交流を行うことができた。



写真 イオンスライサー実習の様子